

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第2部門第1区分
【発行日】平成16年10月28日(2004.10.28)

【公表番号】特表2000-511103(P2000-511103A)
【公表日】平成12年8月29日(2000.8.29)
【出願番号】特願平9-542292
【国際特許分類第7版】
B 0 5 C 5/00
【F I】
B 0 5 C 5/00 1 0 3

【手続補正書】
【提出日】平成15年10月15日(2003.10.15)
【手続補正1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】特許請求の範囲
【補正方法】変更
【補正の内容】

手続補正書

平成15年10月15日



特許庁長官殿

1. 事件の表示

平成09年特許願第542292号

2. 補正をする者

氏名(名称) ミネソタ・マイニング・アンド・
マニュファクチャリング・カンパニー

3. 代理人

住所 〒540-0001
大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMPビル
青山特許事務所
電話 06-6949-1261 FAX 06-6949-0361

氏名 弁理士 (6214) 青山 葆



4. 補正対象書類名 請求の範囲

5. 補正対象項目名 請求の範囲

6. 補正の内容
別紙の通り

方 式 査 方 審



請 求 の 範 囲

1. 塗布面上を流れる塗布液の縁部を画定するエッジガイドであって、湿潤面と、湿潤線に沿って前記湿潤面に接触する非湿潤面とを有し、前記湿潤線が、前記塗布面上を流れる塗布液の表面との接触を維持することができる物理的特性を有し、前記塗布液と前記エッジガイドとの間に非線形湿潤輪郭を形成するエッジガイド。

2. 液体を支持体上に塗布する方法であって、

塗布液を供給するステップと、

1つまたは複数の供給スロットを有する塗布面と、

前記スライド塗布装置の塗布面の前記縁部に沿った長さ方向に延在するエッジガイドであって、湿潤面と、湿潤線に沿って前記湿潤面に接触する非湿潤面を有し、前記湿潤線は、前記湿潤線と塗布面上を流れる前記塗布液の表面との間に接触を維持する物理的特性を有し、前記塗布液と前記エッジガイドとの間に非線形湿潤輪郭を形成するエッジガイドと、を備える塗布装置を形成するステップと、

前記塗布液を前記1つまたは複数の供給スロットから前記スライド塗布装置の塗布面上を支持体まで流すステップと、を含む方法。